滤波器。

在进行图象的微分处理时,把制得的微分滤波 器放回  $P_2$  平面制作时的位置,把要进行微分处理的 图象 f(x, y)放在  $P_1$  平面的  $P_{11}$ 位置(把  $P_1$  平面中 参考源  $\delta(x-x_0, y)$ 取消),进行空间滤波处理,则在 输出平面  $P_3$ 上产生的再生象的振幅分布是:(采用 反射坐标)

$$\begin{split} \mathcal{F}^{-1}[4F(f_x, f_y)] + \mathcal{F}^{-1}[F(f_x, f_y)\mathcal{F}[\delta(x + h, y) - \delta(x, y)]e^{i2\pi f_x x_0} \\ &+ \mathcal{F}^{-1}[F(f_x, f_y)\mathcal{F}^*[\delta(x + h, y) \\ &- \delta(x, y)]e^{-i2\pi f_x x_0}] \\ = 4f(x_3, y_3) + f(x_3, y_3) &[\delta(x_3 + h, y_3) \\ &- \delta(x_3, y_3)] &\otimes \delta(x_3 + x_0, y_3) \end{split}$$

 $+f(x_3, y_3)*[\delta(x_3+h, y_3)$ 

 $-\delta(x_3, y_3)] \otimes \delta(x_3 - x_0, y_3)$ 式中  $F(fx, fy) \ge f(x, y)$  的傅里叶变换,  $\mathcal{T}^{-1}[$ ] 表示逆傅里叶变换,  $\otimes$  表示卷积运算。

式中的第三项:

 $f(x_3, y_3) * [\delta(x_3+h, y_3) \\ -\delta(x_3, y_3)] \circledast \delta(x_3-x_0, y_3)$ 

就是图象 f(x, y) 的一阶偏微分  $\frac{\partial f}{\partial x}$ 。它呈现在输出 平面  $P_3$  的相关项的位置上。

按同样方法,当在  $P_2$  平面分别放置制得的  $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ 的空间滤波器时, 图象 f(x, y) 经过空间滤波处理,在输出平面  $P_3$ 的 相关项的位置上,可分别得到图象的  $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y},$  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ 。 图 2 和图 3 分别是一阶偏微分滤波器的照片和 图象的一阶偏微分  $\frac{\partial f}{\partial x}$ 的结果。



图 3 图象的一阶偏微分 ∂f/∂x 的结果

从图 3 可见,对于一阶偏微分,与微分方向平行 的直线都不出现,利用这一特性,可对汉字进行笔划 分类,结合光学图象的相关处理技术,可进而实现汉 字检索。

> (中国科学院广州电子技术研究所 杨世宁 赵大军 邬国辉 叶关君 黃世锋 廖 挺 谭明业 1980年1月29日收稿)

## 一种精确的光学复位装置

**Abstract**: A mechanical instrument of high reposition accuracy is reported. It has simple structure and can be made easily. The accuracy of reposition is up to the order of a few microns. It is an efficient tool for optical information processing in the reposition of complex spatial filters.

特征识别、空间滤波、相干光无损检验等工作中 复空间滤波器和全息图复位问题是一非常重要的问题,致使有些工作必须原位显影来解决,然而原位显 影虽然能做到滤波器位置的严格复位,但必须增加 额外显影设备;另一方面,在有些实验中,必须对银 盐片乳胶特性曲线严格控制,这就要求对显影液的 温度、流速、显影时间、停显快慢等严格控制,因此增 加了原位显影装置的复杂性,甚至不可能。本文介 绍的复位装置,是靠机械设计的合理性来保证的,装 底片的不锈钢架可以方便地取出放上,均能保证复

## 位精度到几微米。

现将其基本结构介绍如下。

1. 主体支架(见图1)



主体支架下半部有两根倾斜 45°的圆柱支杆, 在平面中心圆周上有三根紧配合的短圆柱体,三圆 柱上端面在与支架平面平行的平面上进行 磨削后, 构成底片架的支撑平面,支架上部有一扣紧簧片。图 中二面装配是为了同时装两个滤波器设计的。

2. 底片架(见图2)

靠锁紧螺钉可将底片平整牢固地安装在底片架 面上,架底平面一边开有70°的角槽,为了力的平 衡,角槽顶线与架面夹角45°,另一边开一长10毫



米的方槽,槽底平面亦同架面夹角45°,两槽中心距 与主体支架上两杆中心距相等,长方槽是为了保证 上下方便,接触稳定。在图2中底片安装在后面突 出部分,为了同时放两个滤波器时,尽可能靠近又不 影响复位。

将底片架放入主体支架倾斜两杆上时,两槽正 好骑在两杆上,并为线接触,而且簧片紧扣压底片 架,使底片架平面紧贴三圆柱端面,底片架两槽紧贴 两杆,这样底片在空间位置完全定位,只要簧片弹力 选择合理,底片架就能方便地从主体支架取下或放 上,而空间位置不变。

> (中国科学院物理研究所 郑师海 吴祖安 1980年2月4日收稿)

## 新式反馈控制气体激光稳流电源

**Abstract**: A feedback-controlled current stabilized power supply for CO<sub>2</sub> wave-guide lasers is reported. Current is stabilized in the range of  $2\sim4$  mW, the unstability of the current is less than 1% with respect to 20% fluctuation of network voltage.

我们采用把控制晶体管接在交流电源测桥式整 流器直流输出端进行电流负反馈控制的方式,研制 成了供输出功率为2瓦的CO2波导激光器使用的稳 流电源。电源的原理电路和电压电流波形分别示于 图1和图2。

假设升压变压器 SB 为一理想变压器,漏感L。 为零,初级电感L1为无穷大;次级负载折算到初级为 一纯电阻 B;注入晶体管 BG 基极的电流为一定值 i<sub>bo</sub>下面我们借助于图 1(b) 和图 2 定性分析一下晶 体管 BG 的控制作用。由图 1(b) 可知,负载电流 i<sub>R</sub> 等于集电极电流  $i_{0}$ 。在此,我们只分析电源电压瞬时值 e 处于正半周的情况,负半周也一样。在  $t_{1} \sim t_{2}$ 期间, $0 < e < E_{1}(E_{1}, E_{2})$ —某个设定值), $i_{R} = i_{0} = 0$ 。 在  $t_{2} \sim t_{3}$  期间,  $E_{1} < e < E_{2}$ ,  $i_{R} = i_{0}$  随着 e 的 增 加 而 增加。在  $t_{3} \sim t_{4}$  期间,  $e > E_{2}$ ,  $i_{R} = i_{0} = \beta i_{b}$ 。在  $t_{4} \sim t_{5}$ 期间,  $E_{1} < e < E_{2}$ ,  $i_{R} = i_{0}$  随着 e 的下降而下降。在  $t_{5} \sim t_{6}$  期间,  $e < E_{1}$ ,  $i_{R} = i_{0} = 0$ 。实际上由于  $E_{1}$ 、 $E_{2}$ 都非常小,  $t_{3} \sim t_{4}$  这段时间很宽。所以,流过负载的 电流  $i_{R}$  是一串频率为 50 周、幅度为  $\beta i_{b}$  的矩形 波。 由此看来,如能采用适当的电流负反馈来控制注入

• 56 •